Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No.

S61-144097

Date of First Publication: 1986/07/01

Japanese Patent Application No. S59-266808

Application Date: 1984/12/18

Title of the Invention:

TWO-SIDED WIRING SUBSTRATE

CONDUCTING CIRCUIT FORMATION METHOD

Int. Cl

Identification

Internal Serial Number

H 05 K

3/42

6679-5F

Examination Request: not requested

Number of Inventions: 1

Inventors: Akira OKAMOTO

Applicant: TDK, KK

Agent: Shoei YAMATANI

Claim

A two-sided wiring substrate conducting circuit formation method, characterized in that a through hole is formed in an insulating substrate having a wiring portion provided on both surfaces thereof, a conductor is provided on the periphery of this through hole, a solder resist is applied on the periphery of this conductor, and then by disposing the insulating substrate in a reduced pressure chamber and by carrying out soldering while in a reduced pressure state, a conducting path, which comprises solder in which an end portion thereof is built up, is formed on the through hole.

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 144097

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

函公開 昭和61年(1986)7月1日

H 05 K 3/42 6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

両面配線基板導電路形成方法 60発明の名称

> 願 昭59-266808 创特

願 昭59(1984)12月18日 29出

本 砂発 明 者 岡

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

ティーディーケイ株式 の出

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

個代 理 人 弁理士 山谷 皓祭

两面配盤基板導電路形成方法 発明の名称

2. 特許請求の範囲

その両面に配線部分が設けられる絶縁基板に貫 通孔を形成し、この貫通孔の周囲に導体を設ける とともにこの導体の周囲にハンダレジストを強り。 それから絶録基板を放圧室に配置して放圧した状 息でヘンダ付けを行うことにより、前配貫通孔に こその端部が盛上っているハンダよりなる導電路を 形成したことを特徴とする両面配想基板導電路形 成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は絶縁基板の両側に配線部分が形成され ている配線基板に係り、特にこの配線基板に気流 孔部を形成し、この貫通孔をハンダで導通するこ とにより両面温度路を形成する方法に関する。

「従来技術」

電子回路の小型化,モジュール化等に応じて印 刷配舗基板が各種エレクトロニクス分野に使用さ れており、最近は基板の両側に配線部分を設け、 この両側の電気回路の電気接続を、印刷配線基板 に形成したスルーホールに導電路を設けることに より行つている。

ところでこのようなスルーホール導体の形成手 段として現在ではスルーホールメンキやスルーホ ール印刷などがあり,広く実用に供されている。

[発明が解約しようとする問題点]

しかしメンキの場合には、メンキ用の複雑な工 程が必要のため高価なものとなる。またスルーホ ール印刷の場合は,才 6 図および才 7 図に説明す る如き問題点がある。すなわち、才6図に示す如 く,絶縁基板30亿形成したスルーホール内に強 布された導電性ペースト31が薄い場合には,エ ッジ部分32にカスレが生じこの部分で切断され ることがある。また、才7図のに示す如く、海電 とペースト33が厚すぎる場合には、これを焼成

では、これを焼成

では、これを洗める

では、これを洗 したとき、オ7図(b)に示す如く、パイプ状体34に収縮して絶縁基板30と剣雕することになる。しかも従来の印刷法では印刷用の導電ペーストの粘度が例をは10万~30万cpsと高いため、穴の内面に十分にペーストが盗られるためには0.6 mm Ø位の比較的大きな穴径のものが必安であった。

前記の如き問題点を解決するため、 本発明では、 スルーホールの上下面の周囲に導体を形成し、 こ の導体の周囲にハンダレジストを塗り、 それから

ル、3はスルーホール2の周囲に形成された厚膜 導体、4は回路パタン、5はヘンを周に形である。成立、 で厚膜ではスルーホール2の全域におおびにない。 で原膜ではスルーホール2の全域におおびにない。 を開びでなれていると厚になるとは、 での成が原のでない。 での成が原のでは、ののでは、 でのは、 でいるが、 でい

このときハンダレジスト6のためハンダ5はほとんど流れないので、その表面張力のため端部が 盛上つた状態で固化するので接続状態を完全なも のとすることができる。

もしハンダ5の端部が盛上がらない場合には、 オ3図に示す如く、ハンダ5′が固化するときその 収縮によりエッジ部分7で断線の危険が存在する スルーホール内をヘンダで導電路を構成するため この絶縁基板を減圧室に配置して減圧した状態で ヘンダ付けを行う。

これによりあらかじめスルーホール内に導電路を形成することなく、しかもハンダ端部が盛上った導電路を形成して絶録基板の両側をきわめてかんたんに、しかも確実に電気接続することができる。

〔寒施例〕

まず本発明のメリットを理解するため、本発明により作成された両面配線基板を予2図により説明する。 か2図(の) は本発明により形成された両面導電路の一例であり、同(の) はハンダを付着する以前の絶縁基板のスルーホール部分の状態説明図である。

オ 2 図において、 1 は絶縁基板であつて例えば アルミナ磁器により構成され、その両面に回路パ タンが形成されたりあるいは回路部品が配置され るもの、 2 は絶縁基板 1 に形成されたスルーホー

が, 本発明ではヘンダの増部が盛上つているので, 前配のような断線の危険はない。

なお前配厚膜導体の代りに鍋泊を接着して、エ ッチングで導体を形成してもよい。

次にこのような両面を良好に電気接続するハンダの導電路が得られる。本発明の両面配線基板導電路形成方法をオ1図及びオ4図により、他図を参照しつつ説明する。

- (1) まずアルミナの焼成前の原料であるグリーン シートの基板を用意しこれに貫通孔を所定位置に 形成する。そしてこれを焼成し、貫通孔の形成さ れたアルミナ製の絶録基板が得られる。
- (2) この絶縁基板の両面に回路パタンを印刷する。このとき貫通孔の周囲の部分も所定のパタンを同時に印刷する。それからこれを所定の温度で焼成する。かくしてオ2図(めに示す如く、絶縁基板1上に所定のパタンの厚膜導体を形成することができる。
- (3) このようにして、形成された資通孔の周辺の 厚膜事体に接続する回路パタン4に、オ1図(c)、

Ġ

または(b) に示す如く, ハンダレジスト 6 を塗り, この絶録基板 1 に部品を例えば接着剤で仮止めす る。

(4) それから例をはオ4図に示す工程によりハンダを真空含浸する。これによりオ2図(a)・(b)に示す如く、貫通孔内にハンダ5による導電路を形成させ、これにより絶縁基板1の両面の回路パタン4・4間を端部が盛上つたハンダにより電気接続することができる。

次にオ4図(a),(b)により真空含浸工程を説明する。オ4図(a)は真空含浸用装置であり、同(b)は真空含浸用装置であり、同(b)は真空含浸工法である。

オ4図(のにおいて、10は真空槽であり、弁15を介して真空ボンブ14が接続されており、真空ボンブ14を動作することにより真空槽10の円部は排気され、真空状態になるもの、11はハンダ槽であり、その円部に溶融されたハンダ12があるもの、13はアームであつて、このアーム13に取付けられた支持部16には部品が仮止めされた絶縁基板17、18…がリードフレームLFで

圧に戻す。これにより絶縁基板 1 7 , 1 8 … に形成された貫通孔内に充分ハンダが浸入して、その両面間の電気接続路を形成することになる。勿論これによりリードフレーム、部品も同時にハンダ付けされる。

(7) アーム13を上方に移動して絶録基板17,18…をハンダ棺11から引き上げる。これにより貫通孔内のハンダはその端部が盛上って固まり、しつかりした電気接続が得られることになる。

たお、ハンダ槽11を真空槽10円に設置する 代りに、か4図にに示す如く、ハンダ槽20を大 気圧中に置き、治具22に0リング23を介して 資産孔25を有する絶縁空ボングにこれを 行け、たかは具22を変型ボングになれる。 行り、をからになったがあるよいのでは 20のハンダ21には、部はないのでは 20のかが21には、部はないのである。 により同の如く、では、のいいのののいかで オ4図にの如く、では、のいいのののいかで オ4図にののいかで オ4図にののいかで オ4図にののいかで オ4図にののいかで オ4図にののいっかで オ4図にののいっかで 支持されており、アーム13を適宜手段で下方に移動させて絶縁基板17・18…を溶融ハンダ12中に浸漬することができるように構成されている。なおリードフレームLFはその端部に形成されたグリンプ端子部で絶縁基板17・18の端子部分と接触しており、同時にハンダ付け接続することができる。勿論他の手段により絶縁基板17・18を支持してもよい。

以下真空含浸法についてオ 4 図(b) のフローチャートにより、同(a) を参照しながら説明する。

- (5) 真空槽10円の支持部16に,接着剤で仮止めした部品を有する絶縁基板17,18…を取付ける。
- (6) 弁 1 5 を開いて真空ポンプ 1 4 を選転して真空間 1 0 円を滅圧する。そして 6 0 0 mmH 9 以上減圧して、 7 6 0 6 0 0 = 1 6 0 mmH 9 程度に減圧する。このように 6 0 0 mmH 9 以上減圧してからアーム 1 3 を下降して絶級基板 1 7 ・ 1 8 …をハンダ槽 1 1 にデップする。それから弁 1 5 を閉じ、リーク弁 1 9 を開いて真空槽 1 0 円を大気

することもできる。このとき、貫通孔28を有する絶縁基板27は0リング23を介して治具26 に適宜手段で取付け、この治具26の内側を真空ポンプで滅圧しながらハンダ付けを行うことになる。

 すれば前配隙間の全く生じない, 完全なハンダに よる電気接続路を構成することができた。

これにより 0.3 m m Ø 以下の資通孔をハンダにより導通させることができる。 なおこの質通孔は 焼成後の磁器を例えば O O2 レーザを使用して形成 することもできる。

なお前配説明ではアルミナ製の絶録基板を使用 した例について説明したが、本発明は勿論これの みに限定されるものでない。

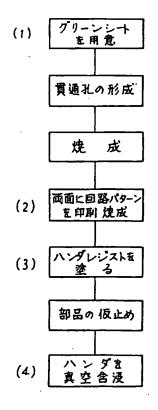
〔効果〕

本発明によれば、貫通孔の内側に特別の導体を 設けることなく非常に簡単に両面接続導電路を形 成することができる。

しかもエッジ部のかすれの生じることもなく, ハンダにより将電路を形成することができる。

1 図

第



4. 図面の簡単な説明

オ1 図は本発明の概略説明図、オ2 図(a) は本発明により形成された両面導電路の一例であり、同(b) はハンダの端部を盛上げる手段の一例を示し、同(c) はハンダを付着する以前の絶縁基板のスルーホール部分の状態説明図、オ3 図は問題点説明図、オ4 図は本発明で使用する減圧浸漬手段の説明図、オ5 図は実験バタンの説明図、オ6 図およびオ7 図は従来例の問題点、オ8 図は従来例である。

1 … … 絶録基板 2 … … スルーホール

3 … … 厚膜導体 4 … … 回路パタン

5 … … ヘンダ

10……真空槽 11……ハンダ槽

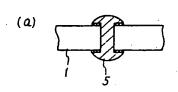
14 … … 真空ポンプ 15 … … 弁

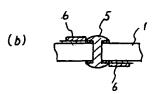
16 … … 支持部 17,18 … … 絶縁基板

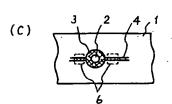
19……リーク弁

特 許 出 顧 人 ティーディーケイ株式会社 代理人 弁理士 山 谷 時 榮

第 2 図







第 3 図

